

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 5 月 19 日 (19.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/045409 A1

(51) 国際特許分類: G01N 27/04, 27/12

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/006583

(22) 国際出願日: 2004 年 5 月 10 日 (10.05.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-378602 2003 年 11 月 7 日 (07.11.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 大阪府
(OSAKA PREFECTURE) [JP/JP]; 〒5400008 大阪府大
阪市中央区大手前 2 丁目 1 番 2 2 号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 長岡 勉 (NA-
GAOKA, Tsutomu) [JP/JP]; 〒5998233 大阪府堺市大
野芝町 2 3 - 4 - 1 1 8 Osaka (JP). 椎木 弘 (SHI-
IGI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒5998237 大阪府堺市深井水池
2 8 6 2 - 1 - B Osaka (JP).

(74) 代理人: 野河 信太郎 (NOGAWA, Shintaro); 〒5300047
大阪府大阪市北区西天満 5 丁目 1 - 3 南森町パー
クビル Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

規則4.17に規定する申立て:

— すべての指定国のための不利にならない開示又は新
規性喪失の例外に関する申立て (規則4.17(v))

添付公開書類:

— 国際調査報告書

— 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する
申立て

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ELECTRICAL RESISTIVITY SENSOR AND SENSING METHOD

(54) 発明の名称: 電気抵抗型検出センサおよび検出方法

(57) Abstract: An electrical resistivity sensor characterized in that a set of electrodes are arranged oppositely on the electrically insulated surface of a substrate and a film of conductive fine particles modified with probe is formed on and/or between the electrodes.

(57) 要約: 本発明は、電気的に絶縁された基板表面に一組の電極が相対峙して配置され、電極上および/または電極間に、プローブで修飾された導電性微粒子の膜が形成されてなることを特徴とする電気抵抗型検出センサを提供することができる。